



- Об оценке эффективности АТМ-коммутаторов методом имитационного моделирования. *Ю. А. Семишин, Ю. Г. Майба, О. В. Литвинова (Украина, г. Одесса)*
- Техника и технология полимерных сферических микролинз для волоконно-оптических систем. *Я. В. Бобицкий, А. П. Лаба (Украина, г. Львов)*



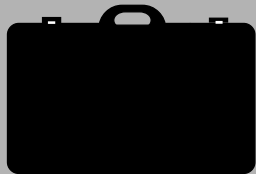
- Методика инженерного расчета акустооптического модулятора. *В. В. Данилов (Украина, г. Донецк)*
- Физические симуляторы мощных транзисторов. *З. Стевич (Югославия, г. Бор)*

- Особенности развития производства интегральных микросхем в современных условиях. *А. А. Мерзвинский (Украина, г. Киев)*
- Проектирование, изготовление и монтаж специализированных БИС. *В. П. Грунянская, В. Д. Жора, Л. М. Солдатенко, И. А. Тучинский (Украина, г. Киев)*
- Решение задачи выбора оптимального варианта конструкции печатных узлов РЭС. *Л. И. Панов, А. А. Матвеев (Украина, г. Одесса)*



- в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции
- Резистивные элементы, полученные на анодном оксиде алюминия имплантацией ионов Ti и Mo. *Г. В. Литвинович, В. А. Сокол, В. В. Углов, И. З. Занг, И. И. Абрамов, А. Л. Данилюк (Белоруссия, г. Минск; КНР, г. Пекин)*
 - Исследование технологических режимов температурной обработки медных оболочек тепловых микротруб. *Ю. Е. Николаенко, В. Ю. Кравец (Украина, г. Киев)*
 - Информационное обеспечение разработки технологических процессов и наукоемкой продукции. *С. Г. Радченко (Украина, г. Киев)*
 - Особенности деградации керамических терморезисторов в режиме импульсных токовых нагрузок. *Н. М. Вакив, Ю. Мацяк, О. Я. Мруз, Ю. Погожельска, О. И. Шпотюк (Украина, г. Львов; Польша, г. Варшава)*
 - Совмещение изображений в системах автоматического оптического контроля печатных плат. *В. Н. Крылов, Г. Ю. Щербакова (Украина, г. Одесса)*
- в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции

в портфеле редакции



в портфеле редакции

в портфеле редакции

- Классификационный анализ акустооптических устройств управления лазерным пучком. *В. В. Данилов (Украина, г. Донецк)*
- Метод проверки значимости оценок коэффициентов модели. *С. Г. Федорченко (Молдова, г. Тирасполь)*
- Об одном способе обработки экспертных оценок. *Д. А. Сеченов, М. Д. Скубинин, В. В. Поляков (Россия, г. Таганрог)*

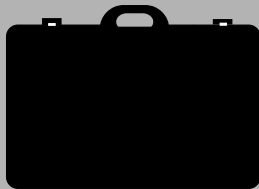
в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции

в портфеле редакции



- Коррекция параметров полупроводниковых приборов с помощью электрического и магнитного полей соответствующей геометрии. *А. А. Ащеулов, Ю. Г. Добровольский, В. А. Безулик (Украина, г. Черновцы)*
- Излучающие поверхностно-барьерные диоды. *А. С. Гаркавенко (Украина, г. Львов)*
- Новые подложки для элементов электроники на основе алмазоподобных пленок. *С. В. Завьялов (Украина, г. Одесса)*
- Влияние режимов спекания на параметры стеклокерамики с кристаллизующимся стеклом. *М. В. Дмитриев (Украина, г. Одесса)*

Одобрено к печати Ученым советом Одесского государственного политехнического университета

Редакция: *П. Ф. Маев, Л. М. Лейдерман, Е. А. Тихонова.*

Техническая редакция: *Е. И. Корецкая.* Компьютерное обеспечение: *А. П. Соломяный.*

Подписано к печати 06.12.99 г. Формат 60×84 1/8. Печать офсетная. Печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 8,1. Тираж 700 экз.

Оригинал-макет изготовлен в ДП «Нептун-Технология» (65028, г. Одесса, ул. Б. Хмельницкого, 59).

Отпечатано в типографии издательства «Астропринт» (65100, г. Одесса, ул. Преображенская, 24, к. 13).